## JAERI-Conf 94-003

# 22a-5

## DEVELOPMENT OF LASER-COMPTON SPOT SIZE MONITOR FOR FFTB-PROJECT

# A. HAYAKAWA, Y. OZAKI, S. NAKABAYASHI, K. YASUDA, M. OHASHI, T. SHINTAKE\* Kawasaki Heavy Industries, LTD 1-1 Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe 650-91, Japan

## ABSTRACT

"Laser-Compton Spot Size Monitor" for measuring size of electron beam was developed. This new spot size monitor has been installed in FFTB - SLAC, in order to measure the electron beam size of 60 nanometer vertical by 1 micronmeter horizontal. In this paper, the development of this monitor is reported.

FFTBプロジェクト用レーザーコンプトンスポットサイズモニタの開発

## 1. はじめに

このレーザーコンプトンスポットサイズモニタ は、平成4年度に川崎重工が高エネルギー物理学 研究所より受注した電子ビームの断面のサイズを 測る装置である。日米科学技術協力事業に基づい てスタンフォード線形加速器センター(以下、S LACと呼ぶ)ではFFTBプロジェクトが進め られている。このプロジェクトでは将来の衝突型 線形加速器の実現に向けて、電子ビームの断面の サイズを60nmまで絞り込むことが試みられてお り、当装置はこのビームサイズを計測するために 平成5年8月、SLACに設置された。当装置は 高エネ研が考案した計測方法<sup>1) 2) 3)</sup>を川崎重工が 初めて開発したものであり、その製作に関して報 告する。

#### 2. 測定の原理

この装置は電子ビームがレーザのフォトンに衝 突してγ線を発生する"逆コンプトン散乱"を利 用している。この方法を用いて計測するために、 まず電子ビームの軌道上で交差するように2本の レーザビームを入射する。この2本のレーザビー ムが交差する空間には干渉縞が発生する。干渉縞 に見られる明暗はフォトンの数の多い少ないに相 当する。従って、飛んできた電子ビームがこの干 渉縞の明部を通るとフォトンとの衝突が起こりγ 線が発生するが、逆に暗部を通るとフォトンとの 衝突がなくなりγ線は発生しなくなる。ここで電 子ビーム軌道上流に設けたステアリングマグネッ トを用いて電子ビームの軌道をこの干渉縞を横切 る方向に動かして、発生するγ線をγ線検出器で 測定する。電子ビームは干渉縞の明暗を周期的に 通るので、検出されるγ線の量はそれに応じて周





期的に変化する。さて、ここで干渉縞の周期的な、 明暗のピッチと電子ビームの断面のサイズの関係 に着目してみる。図1(c)のように電子ビーム のサイズが干渉縞の周期より十分に小さい場合に は干渉縞の明暗に対応してγ線量の変化がみられ るが、(a)のように電子ビームのサイズが干渉

\*KEK:National Laboratory for High Energy Physics

編の周期をいくつかまたがるような大きさになる と干渉縞の明暗に対応した周期的なγ線の変化量 は小さくなる。そこでこの周期的なγ線の変化量 から電子ビームのサイズを知ることができる。但 し、計測できる電子ビームのサイズの範囲は限ら れる。この範囲を変えるには干渉縞のピッチを変 えればよい。干渉縞のピッチdは、使用するレー ザの波長λと干渉縞をつくる2本のレーザビーム の交差角θによって決まる。

$$d = \frac{\lambda}{2 \text{ s i n } (\theta \neq 2)} \quad --- \quad (1)$$

# 3.装置の構成

#### 3-1. 全体の構成

ビームサイズモニタはレーザ発振器、干渉縞を 作る干渉計、 $\gamma$ 線検出器及び制御装置からなる。 その構成図を図2に示す。レーザ発振器は市販品 であるスペクトラ・フィジックス社の Nd:YAG レ ーザ(波長 $\lambda$ =1.064 µm)を使用している。この レーザ発振器から出射されたレーザビームは、電 子ビームの最終収束点に設置された干渉計へ導光 される。なお $\gamma$ 線検出器はSLACに既設のもの を使用した。

# 3-2. 干渉計の構成

電子ビームの進行方向をZ軸、地面に垂直な方 向をY軸、水平な方向をX軸とすると、電子ビー ムの断面はY方向にくらべてX方向が大きい偏平 した形になっている。FFTBプロジェクトが目



図3. 干渉計の3モード

### 表1. 各モードの測定範囲

	レーザ交差角	干涉編ピッチ	測定方向	測定範囲
Mode_1	174	0. 53 µ m	Y	0. 04∼0. 18µm
Mode_2	30°	2. l µ m	Y	0. 16∼0. 72 μ m
Mode_3	6°	10. 2 µ m	Х	0.76~ 3.4μm



図2.装置の構成

標とする電子ビームのサイズはX方向1µm、Y 方向60nmであるので、これにあわせて干渉縞の ピッチを決める。干渉縞を作るために交差させる  $2本のレーザビームの交差角 \theta は (1) 式より決$ まる。今回の干渉計では図3に示すように、6本 に分けたレーザビームのうち2本のレーザビーム を選択することにより、3つのモードを構成した。 各モードで測定される範囲を表1に示す。モード の選択は、6本のレーザビームライン上に設けら れた電動シャッタの開閉により遠隔操作で行う。 また、電子ビームの収束点でレーザビームを正確 に交差させるために、6本のレーザビームを折り 返す電動ミラーで、そのレーザビームの方向を微 調整できるようにしている。他にも干渉計内には、 レーザビームの方向変化を検出するためのPSD (Position Sensing Detector) やレーザビームの プロファイルをモニタするためのCCDカメラが 設置されている。このPSDで検出されたレーザ ビームの方向変化は、レーザ発振器の近くに設置 された電動ミラーで矯正される。

#### 4. 干渉計の製作

干渉計内には、大きさ1.6×1.5m、厚さ110mmの アルミハニカム構造のテーブル上に真空チェンバ ー、ミラーやレンズ等の光学部品、電動シャッタ ー等が固定されている。干渉計内のレーザビーム の位置は正確にアライメントされており、各モー ドでのレーザビーム交差角が正確に決められてい る。これを実証するために、形成される干渉縞の ピッチを確認する試験を行った。レーザビーム交 差角6°と30°は干渉縞の中を¢1µmのピンホー ルをスキャンさせてその透過光強度を測定し、交 差角174°は干渉縞の中を¢2.5µmのタングステ ンワイヤをスキャンさせてその散乱光強度を測定 した。その計測結果を図4-1~3に示す。この結 果より、(1)式より求められる値と一致する干 渉縞が形成されていることが確認できた。

#### 5. まとめ

今回、従来の方法では計測できなかった数十ナ ノメートルの微小な電子ビームサイズが計測可能 なモニタを開発した。現在、当装置はSLACに 設置されており、FFTBプロジェクトにおいて 収束された電子ビームの計測に使用されている。 当装置による電子ビームサイズの計測結果につい ては同報文集の論文、新竹 積 他の『First Beam Test of Nanometer Spot Size Monitor using Laser Interferometry』で報告されているので参 照してほしい。



#### 参考文献

- 1)T. Shintake, "proposal of a nanometer beam size monitor for e+e-linear colliders", Nucl. Instrum. & Methods, A311, (1992) pp. 453-464.
- 2)T. Shintake, H. Hayano, A. Hayakawa, Y. Ozaki, M. Ohashi, K. Yasuda, D. Waltz, S. Wagner and D. Burke, "Design of Laser-Compton Spot Size Monitor", Proc. XVth Int. Conf. on High Energy Accelerators, Hamburg, Germany, July 20-24, 1992, KEK Preprint 92-65, July 1992 A.
- 3)新竹、"ナノメートル電子ビーム径を計る", パリティ Vol.08 No.06 1993-06 p46-51.